

晶片製程與測試實驗室

實驗室簡介

本實驗室目標是建置完整半導體與太陽光電領域之模擬設計、製程及量測分析實務能力之平台，申請政府及民間機構之研究及產學合作計畫，進而培育學生具實務競爭能力，降低學用落差，學生畢業後能順利與相關產業接軌。

開授課程

晶圓製程技術、晶圓製程設備、太陽能電池製程設備與技術實習、太陽能電池量測實習、太陽能系統模組應用實習

儀器設備



Class 10K 無塵室

提供半導體元件製作與量測

- 黃光室
- 電漿增強式化學氣相沉積儀
- 金屬蒸鍍機
- 快速熱退火爐
- 反應式離子蝕刻儀
- 電子束蒸鍍機
- 濺鍍機
- 傅氏遠紅外線光譜儀
- 全波長橢圓儀
- 金相光學顯微鏡
- UV-VIS光譜儀
- α -step膜厚測量儀
- 玻璃切割機
- 加熱爐管



電漿輔助化學氣相沉積 (PECVD)



反應式離子蝕刻機 (RIE)



濺鍍機(Sputter)



光罩對準儀(Mask Aligner)



快速退火爐(RTA)